

# マスフローコントローラ(水素・ヘリウムモデル)

形 MQV□□□



形番	MQV9020	MQV9050	MQV9500	MQV0005	MQV0010	MQV0050	MQV0200
標準フルスケール流量(空気)	20.0 mL/min (standard)	50.0 mL/min (standard)	0.500 L/min (standard)	5.00 L/min (standard)	10.00 L/min (standard)	50.0 L/min (standard)	200 L/min (standard)
対応ガス種	水素(H <sub>2</sub> )、ヘリウム(He) ただし、塩素、硫黄、酸等の腐食成分を含まない乾燥気体であること。 また、ダストおよびオイルミストを含まない清浄気体であること。						
制御	制御範囲(空気)	1~100% FS					
	応答性(標準差圧にて)	設定±2%FS以内に0.5s(TYP.)		設定±2%FS以内に0.3s(TYP.)			
	精度(標準温度・標準差圧にて、Q:流量)	±0.5%FS (0%FS≤Q≤50%FS) ±1.0%FS (50%FS<Q≤100%FS)	±1.0%FS (0%FS≤Q≤100%FS)	±0.5% FS(0% FS≤Q≤40% FS) ±1.0% FS(40% FS<Q≤80% FS) ±2.0% FS(80% FS<Q≤100% FS)			
圧力	動作差圧範囲	300 kPa 以下(-10°C≤T≤60°C)					
	許容入口圧	0.5 MPa (gauge)					
許容動作温度範囲	-10~+60°C						
アナログ入力	0-5V dc / 1-5V dc / 0-20 mA dc / 4-20 mA dc(切替可能)						
アナログ出力	0-5V dc / 1-5V dc / 0-20 mA dc / 4-20 mA dc(切替可能)						
通信方式	①専用ローダ通信 ②RS-485通信(3線式)						
定格電源	DC 24V、消費電流300mA 最大						
接ガス部材質	SUS316、フッ素樹脂、フッ素ゴム ホウケイ酸ガラス、シリコン			SUS316、フッ素樹脂、フッ素ゴム			
接続方式	1/4" Swagelok, 1/4" VCR			Rc 1/4", 1/4" Swagelok, 1/4" VCR, 9/16-18 UNF			
質量	約1.1kg			約1.2kg			

